

경사형 회전 플라즈마 강화 화학 기상 증착 Pecvd 장비 튜브로 머신

품목 번호: KT-PED



소개

PECVD 코팅 장비로 코팅 공정을 업그레이드하세요.
LED, 파워 반도체, MEMS 등에 이상적입니다. 저온에서
고품질의 고체 막을 증착합니다.

자세히 알아보기

샘플 홀더	크기	1-6 인치
샘플 홀더	회전 속도	0-20rpm 조절 가능
샘플 홀더	가열 온도	≤800°C
샘플 홀더	제어 정밀도	±0.5°C SHIMADEN PID 컨트롤러
가스 퍼지	유량계	MASS FLOWMETER CONTROLLER (MFC)
가스 퍼지	채널	4 채널
가스 퍼지	냉각 방식	순환 수냉식
진공 챔버	챔버 크기	Φ500mm X 550mm
진공 챔버	관찰 포트	배플이 있는 전체 뷰 포트
진공 챔버	챔버 재질	316 스테인리스 스틸
진공 챔버	도어 타입	전면 개방형 도어
진공 챔버	캡 재질	304 스테인리스 스틸
진공 챔버	진공 펌프 포트	CF200 플랜지
진공 챔버	가스 입구 포트	φ6 VCR 커넥터
플라즈마 전원	소스 전원	DC 전원 또는 RF 전원
플라즈마 전원	결합 모드	유도 결합 또는 평판 용량 결합
플라즈마 전원	출력 전력	500W-1000W
플라즈마 전원	바이어스 전원	500v
진공 펌프	예비 펌프	15L/S 베인 진공 펌프
진공 펌프	터보 펌프 포트	CF150/CF200 620L/S-1600L/S
진공 펌프	릴리프 포트	KF25
진공 펌프	펌프 속도	베인 펌프:15L/s, 터보 펌프:1200l/s 또는 1600l/s
진공 펌프	진공도	≤5×10 ⁻⁵ Pa

진공 펌프	진공 센서	이온화/저항 진공 게이지/막 게이지
시스템	전원 공급	AC 220V /380 50Hz
시스템	정격 전력	5kW
시스템	치수	900mm X 820mm X870mm
시스템	무게	200kg